

高性能マスクアライナー

LAシリーズ

標準機

コンパクトな微細露光のスタンダード機

4/6/8インチ 標準マスクアライナー

本装置は、半導体素子デバイス等フォトリソグラフィーを必要とする研究分野において、微細度の高いパターン露光ができる露光装置です。

Φ8インチマスクアライナー

LA810



Φ4インチマスクアライナー

LA410

Φ6インチマスクアライナー

LA610



特 徴

- ◆ 専用にデザインされた双対物2視野CCD顕微鏡を搭載
- ◆ 対物レンズ間隔最小18mmで小型試料のアライメントまで可能
- ◆ ワイプ装置による2視野一括モニター表示
- ◆ Z軸は、エア圧駆動+ギャップ微調整レバー方式
- ◆ ハードコンタクト・ソフトコンタクト・プロキシミティー露光に対応
- ◆ 平行機構は信頼性の高い球面軸受を採用
- ◆ コンパクトで高い汎用性

標準仕様	LA410(4インチ)	LA610(6インチ)	LA810(8インチ)
◆露光方式	1:1(等倍)コンタクト露光		
◆適応マスク	最大□5インチ	最大□7インチ	最大□9インチ
◆適応試料	最大φ4インチ	最大φ6インチ	最大φ8インチ
	試料台の交換により各種サイズ・形状(角形試料など)に対応します。		
◆ランプハウス	250W コリメータレンズ	250W インテグレートレンズ	500W インテグレートレンズ
有効露光範囲	Φ80mm以上	Φ165mm以上	Φ210mm以上
主波長	λ=365nm		
放射強度	約6mW/cm ² 以上(at 365nm)	約11mW/cm ² 以上(at 365nm)	約12mW/cm ² 以上(at 365nm)
照度均一度	±15%以下	±5%以下	±5%以下
◆顕微鏡	2視野CCD顕微鏡+モニター 総合倍率100倍(モニター9インチ時)		
◆アライメント方式	顕微鏡による目視アライメント (マスク位置固定・試料移動型アライメント)		
◆アライメントステージ	XYZ軸 微粗動ハンドル操作、θ軸 微動ハンドル操作 Z軸コンタクト・ギャップ微調整 レバー操作 ±125μm レベル(水平)調整 球面摺動機構 真空ロック可能		
◆マスク架台	ヒンジ開閉式		
◆寸法/重量	670(H)×460(W)×540(D)mm	900(H)×850(W)×700(D)mm	1800(H)×1200(W)×900(D)mm
◆ユーティリティ (UV光源装置込み)	電源 AC100V 10A 以下	電源 AC100V 15A 以下	電源 AC100V 15A 以下
	真空 600mmHg以下 圧縮ドライエアまたは窒素 5Kg/cm ² 以上		

販売元

製造元

(改良のため仕様・意匠は変更されることがあります)

sanmei 株式会社 三明

〒424-0825 静岡県静岡市清水区松原町6-16
電話 (0543)53-3271 Fax (0543)52-1648



株式会社 ナノテック
Nanometric Technology Inc.

〒174-0041 東京都板橋区舟渡3-5-8-201 電話 (03)3960-3171 Fax (03)3960-3174

www.nanotech-inc.co.jp
info@nanotech-inc.co.jp